

材料技術講習会のご案内

- XPS の測定原理・測定方法 -

山梨県産業技術センター

このたび当センターでは、X線光電子分光分析装置（XPS）を導入しました。XPSは、試料にX線を照射したときに表面から数nmまでの最表面から発せられる光電子を分光し、試料極表面の化学結合状態を分析する装置です。また、Arイオンエッチングにより試料表面を削るたびに測定することで、深さ方向の分析もできます。この設備を有効に活用するため、XPSの測定原理や測定方法に関する講習会を次のとおり開催します。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

- 日 時 令和6年2月8日（木） 13:30 ～ 16:30
- 会 場 山梨県産業技術センター イノベーション支援棟 2階 イノベーションルーム2
（〒400-0055 甲府市大津町 2094）
- 講 師 日本エフイー・アイ株式会社
シニアプロダクトスペシャリスト 齋藤 健 氏
- 内 容 XPSの測定原理、測定方法
- 参加料 無料
- 定 員 50名
- 申込み 下記申込書にご記入の上、FAX（055-243-6110）または、
メール（yitc-kit03@pref.yamanashi.lg.jp）にて
開催前日の2月7日（水）までにお申し込みください。
- 問合せ先 山梨県産業技術センター 材料・燃料電池技術部 工業材料科
TEL：055-243-6111 担当：阿部、石田、鈴木、深澤

参 加 申 込 書

貴社名 _____ :
連絡ご担当者 _____ :
TEL _____ :

部 署 名	氏 名

※お申込みいただいた個人情報、開催事務のみに使用します。

※申込みいただいた会社名は、講師にお知らせいたしますことをご了承ください。